業 解説

キャビティリングダウン吸収分光法によるプラズマ計測

Plasma Diagnostics by Cavity Ringdown Absorption Spectroscopy

佐々木浩一 SASAKI Koichi 北海道大学大学院工学研究院量子理工学部門 (原稿受付:2014年8月1日)

キャビティリングダウン吸収分光法は、主に気体中の微量原子/分子等を高感度に検出し、その密度を求め る方法として、様々な分野で広く用いられている。一対の高反射率ミラーからなるキャビティの内部に測定対象 を置き、キャビティ内でレーザー光を多数回往復させるという単純とも思われる工夫により、通常のレーザー吸 収分光法の10⁴倍以上の高感度が容易に得られ、反応性の高さ故にプラズマ中で低密度となる反応中間種の密度 計測、および、遷移確率が小さいために通常の吸収分光法では検出が困難なラジカル種の密度計測などにおいて 威力を発揮する.本解説では、キャビティリングダウン吸収分光法の原理について基礎的事項を含めて述べた後、 キャビティリングダウン吸収分光法を用いたプラズマ計測について、主に我が国における取り組みを紹介する.

Keywords:

cavity ringdown spectroscopy, laser absorption spectroscopy, radical density, sensitive measurement, plasma diagnostics

1. はじめに

プラズマや気体などにレーザー光を入射したとき、レー ザー光子のエネルギーがプラズマ中に存在する原子・分 子・イオンの二つのエネルギー準位の間の差エネルギーに 一致していると、レーザー光子は原子・分子・イオンに よって吸収される.これは光子の消滅を意味するので、気 体を透過したレーザー光の強度は入射したレーザー光の強 度より低下する.気体を透過したレーザー光の強度がどれ だけ低下したかを測定し、レーザー光を吸収した原子・分 子・イオンの数密度を算出する方法は、一般にレーザー吸 収分光法と呼ばれている.

キャビティリングダウン吸収分光法 (Cavity Ringdown-Absorption Spectroscopy (CRDS))は、レーザー吸収分光 法の感度を飛躍的に高める方法として、様々な分野で広く 用いられている. この方法は、もともとは反射率が 99.9% を超えるミラーの反射率を正確に決定するための方法とし て考え出されたものだが[1], 1988年に気体中の微量元素 /分子の検出・密度測定に応用され[2],今日まで発展を 遂げてきた.プラズマ診断への応用としては、1993年に米 国のBar Haborで開催された第6回レーザー応用プラ ズマ計測国際会議 (International Symposium on Laser-AidedPlasma Diagnostics (LAPD)) において初めて紹介 され[3],本コミュニティが CRDS という方法を知ること になった.その後, 1997年にオランダの Doorwerth で開催 された LAPD 8 においてヨーロッパ各国から CRDS を用い た反応性プラズマ計測に関する大量の発表がなされたこと を印象的に記憶している.

このように、CRDSは、プラズマ計測に応用されてから でも20年を超える年月を経ていて、既に新しい方法ではな い.1997年のLAPD8の時、誰が最初にこの方法を導入す るのかに関して日本人参加者間で牽制し合ったことを覚え ているが、その後、我が国のプラズマ計測コミュニティに おける CRDSの利用は不思議なことに非常に遅れた.この ような経緯もあり、我が国では、CRDS が比較的新しいプ ラズマ計測法と思われている場合もある.しかし、世界的 に見れば CRDS は既に成熟した方法に位置づけられる.そ のため、ヨーロッパの先達を差し置いて筆者が CRDS につ いての解説を書くことには大きな抵抗感を覚えたが、日本 語で書かれた解説が学生等の手助けになる場合もあるかも しれないと思い直し、本解説の作成を引き受けた次第である.

上に述べたとおり、CRDSは既に長い歴史を有していて、 現在では様々な変形・発展形が存在する.しかし、本稿で は、誌面の都合もあり、原型および原型に近い CRDS につ いて、その原理を初学者でも理解できる事項から段階的に 述べる.次に、我が国において行われた研究を中心に、 CRDS を利用したプラズマ計測の事例を紹介する.CRDS については既に成書が2編出版されているので[4,5]、本 解説を読んでCRDSに興味をもたれた方は是非これらにつ いても参照していただきたい.

2. キャビティリングダウン吸収分光法の基礎

2.1 レーザー吸収分光法の原理

周波数 ν の単色レーザー光が一様なプラズマ中を距離 *l* 通過するとき、プラズマに入射したレーザー光の強度

Division of Quantum Science and Engineering, Hokkaido University, Sapporo, HOKKAIDO 060-8628, Japan

author's e-mail: sasaki@qe.eng.hokudai.ac.jp

 $I_0(\nu)$ とプラズマを透過したレーザー光の強度 $I_t(\nu)$ との間 には

$$I_{t}(\nu) = I_{0}(\nu) \exp(-\alpha(\nu)l), \qquad (1)$$

の関係がある[6]. $\alpha(\nu)$ は吸収係数, $T(\nu) = I_t(\nu)/I_0(\nu)$ は透過率, $A(\nu) = 1 - T(\nu)$ は吸収率と呼ばれている.

吸収係数 *α*(*ν*) は

$$\alpha(\nu) = \frac{h\nu B_{12}}{c} \left(n_1 - \frac{g_1}{g_2} n_2 \right) g(\nu), \qquad (2)$$

で与えられる.ここで, c は光速度, h はプランク定数, g_1 および g_2 はそれぞれ下準位および上準位の統計重率, n_1 および n_2 はそれぞれ下準位および上準位の密度である. アインシュタインの B 係数 B_{12} は吸収線の遷移確率 A_{21} と

$$B_{12} = \frac{c^3}{8\pi\nu^3 h} \frac{g_2}{g_1} A_{21},\tag{3}$$

の関係にある. g(ν) は吸収線のスペクトル分布を表す関数 で,

$$\int_0^\infty g(\nu) \,\mathrm{d}\nu = 1, \qquad (4)$$

となるように振幅が規格化されている.気体やプラズマを 対象とした可視・紫外域での吸収分光計測を考えると, $g(\nu)$ は測定対象原子・分子が熱運動することに起因する ドップラー広がりで決まり,

$$g(\nu) = \frac{1}{\Delta \nu_{\rm d}} \sqrt{\frac{\ln 2}{\pi}} \exp\left\{-\frac{\ln 2\left(\nu - \nu_0\right)^2}{\Delta \nu_{\rm d}^2}\right\},\tag{5}$$

$$\Delta \nu_{\rm d} = \nu_0 \sqrt{\ln 2} \sqrt{\frac{2kT}{Mc^2}},\tag{6}$$

となる.ただし、 ν_0 は吸収中心の周波数、kはボルツマン 定数、Mは粒子の質量、Tは粒子の温度であり、 $\Delta\nu_d$ はドッ プラー広がりの半値半幅である.

以上から,遷移確率が既知の吸収線において $I_0(\nu)$ および $I_t(\nu)$ を測定すれば, $n_1 \gg n_2$ の場合に下準位の密度 n_1 を求めることができる.下準位としてラジカル種等の基底状態を選べば,その密度を絶対値として求めることができる.

準位1と準位2の差エネルギーがプラズマの電子温度に 比べて大きければ、 $n_1 \gg n_2$ はレーザー光子場のないとき にはよく成り立っている.しかし、レーザー光子場のある 状況では、準位1が準位2に励起されることにより n_1 が減 少するとともに n_2 が増加し、そのため、 $n_1 \gg n_2$ が成り立た

なくなる場合がある.このとき、(2)において $n_1 - \frac{g_1}{g_2}n_2$ が減少することにより吸収係数は減少し、吸収が小さく観 測される.この現象を吸収の飽和という.吸収の飽和の程 度は飽和パラメータと呼ばれる

$$S = \frac{B_{12}\rho_{\nu}}{R^*},\tag{7}$$

によって評価され,吸収の飽和が無視できるためには

 $S \ll 1$ が必要である.ただし、 ρ_{ν} はレーザー光のスペクトル エネルギー密度、 R^* はエネルギー準位系の実効緩和周波 数で、 R_1 および R_2 をそれぞれ下準位および上準位の緩和 周波数として $1/R^* = 1/R_1 + 1/R_2$ で与えられる.吸収の飽和 が生じているにも関わらずそれに気づかずに n_1 を算出す ると、それは正しい値よりも小さく評価されることにな る. n_1 を求めることを目的とするレーザー吸収分光法では $S \ll 1$ の条件で実験を行う必要がある.

2.2 レーザー吸収分光法の感度

図1は(1)式で表される *al* と吸収率 $A = 1 - I_t/I_0$ の関係 を図示している.吸収が容易に視認できるのは $A \ge 0.01$ の場合と考えられる.一方,吸収が強すぎて $A \ge 0.99$ とな ると, *A* の測定における僅かな誤差が n_1 には大きな誤差と して跳ね返ってくることがわかる. $0.01 \le A \le 0.99$ を吸収 分光計測が容易に行える条件であると考えると,図1か ら,レーザー吸収分光法の測定ダイナミックレンジは $1 \times 10^{-2} \le al \le 5 \times 10^0$ のおよそ 25桁となる. 25桁という ダイナミックレンジを広いと感じられる方もあるかもしれ ない.しかしながら, *al* を決める要因のうち*a* は測定対象 分子・原子の密度および吸収線の遷移確率で決まり,吸収 長*l* も測定対象プラズマのサイズで決まるので,実験対象 のプラズマ中の原子・分子について *al* がちょうど測定可 能なダイナミックレンジの中央あたりにあるのはむしろ稀 である.

感度が過剰 $(al \ge 5 \times 10^{\circ})$ な場合には、プラズマ容器の 中に観測ポートを突っ込んでlを無理やりに短くする方 法、および、吸収線の中心波長から離れた波長域における 吸収プロファイルをフィッティングする方法が取られる (光源に狭帯域レーザーを用いた場合に限られる).

感度が不足する場合 $(al \le 1 \times 10^{-2})$ の最も一般的方法 は、レーザー光をプラズマ中で多重回往復させ、lを大き くする方法である.ホワイトセル[7]と呼ばれる一対の凹 面鏡を用いると、レーザー光を32-64回程度往復させるこ とは比較的容易とされている.しかしながら、この方法に よる感度の改善はせいぜい2桁弱である.さらに感度を増 大させたい場合にはFM変調分光法を用いる.この方法は、 レーザーの発振波長をある周波数幅でFM 変調し、透過光



図1 吸収率 A と α I の関係 A = 1 - exp(-αI)を図示した結果.

の強度のわずかな変化をロックインアンプで視認できるレベルに増幅する方法で, $A \simeq 10^{-4}$ 程度までの吸収を観測することができる.

2.3 キャビティリングダウン吸収分光法の原理

FM 変調レーザー吸収分光法を用いても感度が不足する 場合には、共振器を用いて感度を増強した吸収分光法を用 いる必要があり、その代表が CRDS である. CRDS で は、図2に示すように、レーザー等で用いられるのと同じ ファブリ・ペロー共振器の内部に測定対象となるプラズマ を置く.レーザー光は共振器ミラーを介して共振器中に注 入され、共振器を透過したレーザー光の強度が受信され る.

よく知られているファブリ・ペロー共振器の理論による と、内部が空の安定型共振器 (empty cavity) 内での光子の 寿命は

$$\tau_0 = \frac{L}{c(1-R^2)},$$
 (8)

で与えられる.ただし, L は共振器長, R は共振器を構成 する2枚のミラーの反射率(1枚あたり)である.CRDS では,共振器内における光子の寿命をリングダウン時間と 呼び,その逆数をリングダウン周波数と呼ぶ.図3は, L=1mの空の共振器のリングダウン時間をミラーの反射 率の関数としてプロットしたものである.ミラーの反射率 が99.98%を超えるとリングダウン時間が急激に増加する ことがわかる.リングダウン時間に光速度をかけるとリン グダウン時間の間にレーザー光が伝搬する距離が求まる が, R=99.995%の場合にそれは約10 kmとなる.1mの共







図3 共振器ミラーの反射率とリングダウン時間の関係.

振器を用いているのにもかかわらず,都市と都市との間の 距離に匹敵する伝搬距離(吸収長)を実現することができ る.

共振器の内部に吸収体(プラズマ)が存在する場合,リ ングダウン周波数は以下のように大きくなる.

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_0} + c \frac{al}{L}.$$
(9)

したがって, 共振器内に吸収体がない場合(プラズマが OFFの場合)と吸収体がある場合(プラズマがONの場合) のリングダウン周波数を測定すれば, 吸収係数αが求まり, 吸収体の密度 n₁ を求めることができる.

2.4 キャビティリングダウン吸収分光法の実現

リングダウン周波数は、共振器内へのレーザー光の注入 を止めた時に検出器で観測される光強度の時間変化を実測 することにより求める.パルスレーザーを光源に用いた場 合の実験の様子を図4に示した. レーザーのパルス幅が光 が共振器を一往復する時間 2L/c より短ければ,図4(a)に 描いているように、共振器内でレーザーパルスの重ね合わ せによる干渉が生じず, 往復回数が異なるレーザーパルス が出射側ミラーから次々に漏れ出て、パルス列となって検 出器に到達する、そのため、検出器につないだオシロス コープには図4(b)に示したような波形が記録される.た だし、検出器およびオシロスコープがレーザーパルスの波 形を記録できるだけの周波数特性を有していない場合に は、図4(b)の包絡線に相当する波形が記録される.図4 (b)の包絡線を指数関数でフィッティングすればその時定 数からリングダウン時間が求まる.図4(b)の波形を得る ために必要な入力レーザーパルスは一つであることに注意 しよう.通常、パルス波長可変レーザーの出力強度はレー ザーショットのたびにばらつくが、I₀とI₄の比から吸収を 求める場合にはそれが大きな障害となる。CRDS ではレー ザー光の強度でなくリングダウン時間から吸収係数を求め るので、レーザー光強度のばらつきの影響を受けない利点 がある.

連続発振波長可変レーザーを光源に用いたCRDSを図5 に示す.共振器長がレーザー半波長の整数倍でなければ, 多重回往復するレーザー光は共振器内で干渉し,互いに打



図4 パルスレーザーを光源に用いた CRDS.

Commentary



図5 連続発振レーザーを光源に用いた CRDS.

ち消し合ってその強度はゼロとなる(ファブリ・ペロー干 渉計).そのため,共振器ミラーの一方をPZTで保持 し、それにノコギリ波などの波形を有する電圧を印加して 共振器長を波長オーダーで微少掃引する. 共振器を透過し たレーザー光強度のモニターからレーザー波長と共振器長 とが共鳴した瞬間を検出し、その瞬間に光スイッチを用い て入射レーザー光を高速に遮断する.このようにすると, 検出器で測定されるレーザー光強度は指数関数的減衰を示 し、その時定数からリングダウン時間を求めることができ る. 光スイッチには音響光学変調器 (Acousto-Optic Modulator (AOM))を用いることができる.連続発振波長可変 レーザーは狭帯域でレーザー吸収分光法の光源として理想 的だが、従来はリング色素レーザー以外に選択肢がなかっ た. リング色素レーザーは高価で光学調整が難しい装置で あり、その導入および運用は容易でなかったが、現在では 安価でメンテナンスフリーの運用が可能な半導体レーザー を活用することができる[8].

2.5 キャビティリングダウン吸収分光法の注意点

パルス波長可変レーザーのパルス幅は光励起に用いる レーザーのパルス幅で決まり、励起光源にNd:YAG レー ザーを用いる一般的な場合では, 8 ns 程度である. 一方, L=1mの共振器を光が一往復するのに要する時間は6.7 ns であるから、共振器内を多重回往復するレーザーパルスは 互いにある程度干渉する. また, パルス波長可変レーザー の出力は典型的に 0.2 cm⁻¹(6 GHz) 程度の線幅を有してい て、線幅内は光子でまんべんなく埋められているのではな く、そのスペクトルは、レーザー共振器の縦モードで決ま る離散的な構造を有している.一方,ドップラー広がりで 決まる吸収線の線幅も典型的に1GHzのオーダーにある. したがって、共振器内での干渉の影響を受けたレーザー光 の縦モードスペクトルをよく把握しておかないと、測定で 得られた見かけの吸収係数から n1 を算出するときに誤差 を生じる.この意味では、光源にはできる限り単一モード の連続発振波長可変レーザーを用いることが望ましい.

また, CRDS では通常の吸収分光法以上に吸収の飽和に 注意する必要がある. 共振器ミラーの反射率が 99.99% で あれば, 共振器内には検出器に届くのよりも10000倍強い レーザー光が存在する. この場合には, アバランシェフォ トダイオードのような比較的感度の高い検出器を用いた場 合にようやく検出できる程度にまで入射レーザー光の強度 を低下させたとしても、共振器内のレーザー強度が飽和レ ベルに達することがある.(7)式の飽和パラメータは遷 移確率に比例するので、遷移確率が小さいために吸収が小 さく CRDSを必要とする場合には吸収の飽和は比較的生じ にくいが、遷移確率が大きいものの吸収体の密度が低いた めに CRDSを必要とする場合には特に注意が必要であ る.CRDSにおける吸収の飽和については次章において実 例を示す.

本章の最後に、CRDS をプラズマ計測に適用する場合の 実際的問題について述べる. CRDS は、プラズマが有無の 場合のリングダウン周波数(1/r および1/r₀)の違いから吸 収係数を求める方法なので、空の共振器のリングダウン周 波数1/10 が小さいときに高い感度が得られる.これは、で きる限り反射率の高いミラーを用いて共振器を構成し、共 振器内での付加的な光子損失をできる限り低減することを 意味する. ミラーの反射率としては, 近赤外および可視域 では99.995%を超える反射率を有するミラーが比較的容易 に入手でき、高価ではあるが 99.999% を超える反射率を有 するミラーも入手可能である.一方,紫外域での高反射率 膜コーティングの技術は近赤外・可視域より劣り、反射率 が99.9%を超えるミラーの入手は容易でない.紫外域では CRDS のうまみが低減することになる.また、プラズマは 何らかの容器の中で生成される場合がほとんどであり、容 器内を外部から覗くために光学窓が用いられる.窓を共振 器の内部に置くと付加的な光子損失が生じるので、共振器 ミラーは容器の内部に設置する必要がある.このとき、プ ラズマの反応性粒子や高エネルギー粒子がミラーに到達す ると、ミラー表面に堆積膜が生じたりミラー表面がエッチ ングされるため、ミラーの反射率が低下する. ミラー表面 を清浄に保つため、ミラーの前に複数の光学絞りを置く方 法やミラー近くからアルゴンガスなどを流して反応性粒子 を追い返す方法がとられているが、このような工夫により プラズマが本来測定されるべき状態から変化する可能性が あるので注意が必要である.

3. キャビティリングダウン吸収分光法の実例 3.1 準安定状態窒素分子 №2(A³∑⁺₄)の密度測定

窒素分子の $A^{3}\Sigma_{u}^{+}$ 状態は準安定状態であり,放電維持な どに対する寄与が従来から指摘されてきた.筆者らは,大 規模集積回路の製造工程で必要となるシリコンの窒化に対 する $N_{2}(A^{3}\Sigma_{u}^{+})$ の寄与に興味をもち,窒素プラズマ中の $N_{2}(A^{3}\Sigma_{u}^{+})$ の絶対密度と窒化特性を比較することを計画 した.窒素分子の $B^{3}\Pi_{g} - A^{3}\Sigma_{u}^{+}$ 遷移 (First Positive System)の遷移確率は 10^{4} s⁻¹のオーダーにあり[9],この遷 移の吸収を通常の吸収分光法で測定して $N_{2}(A^{3}\Sigma_{u}^{+})$ の密 度を求めることは不可能であるため,CRDSを適用するこ ととした.

誘導結合窒素プラズマで観測されたリングダウン曲線の 例を図6に示す[10]. 光源には単一モードで連続発振する 半 導 体 レー ザー (2 mW) を 用 い, 吸 収 線 に は $B^{3}\Pi_{g}(v''=2)-A^{3}\Sigma_{u}^{+}(v'=0) の Q_{22}(14), R_{21}(4), およ$



図6 誘導結合窒素プラズマ中の N₂(A³Σt)によるリングダウン 曲線.空の共振器のリングダウン曲線と比較して示してい る.

び、 $Q_{33}(9)$ (波長 771.10 nm 付近)を用いた.図6は、入 射レーザー光を AOM を用いて高速遮断した後に共振器を 透過したレーザー光強度の時間変化を示している.プラズ マを生成しないときのリングダウン曲線は指数関数で完璧 にフィッティングでき、 $1/\tau_0 = (1.756 \pm 0.003) \times 10^4 \, \text{s}^{-1}$ のリ ングダウン周波数が得られた.この値は共振器ミラーの反 射率が 99.997% であることを意味している.CRDS で高い 感度を得るためには $1/\tau_0$ が小さいことが必要だが、その他 に、測定のたびに得られる $1/\tau_0$ のばらつきが小さいことが 重要である.上に示した測定誤差の $30 \, \text{s}^{-1}$ は、同じ測定を 10回繰り返したときの結果のばらつきを標準偏差で示した ものである.これにより $1/\tau - 1/\tau_0$ として視認可能な最低値 を評価すると、alの検出限界として 10^{-7} が得られた.通常 の吸収分光法に比べて非常に高い感度であるが、CRDS と しては標準的な値である.

図6でプラズマを生成したとき、リングダウン周波数は プラズマを生成しないときに比べて大きくなっており、 $N_2(A^3\Sigma_u^+)$ による吸収が検出できていることを示してい る.また、リングダウン曲線が指数関数でなくなっていて、 リングダウン周波数が時間の経過とともに増大しているこ とがわかる.レーザー光の強度が弱まるにつれて吸収が大 きくなっていることを示すこの結果は、吸収の飽和による ものであり、入射レーザー光強度を弱めて実験を行わなけ れば $N_2(A^3\Sigma_u^+)$ を正しく求められない、筆者らは、共振器 内のレーザー光強度を弱める別の方法として、共振器長を 共鳴長からわずかにずらす方法を用いて吸収の飽和を防止 した.

図7は、図6の測定を様々な波長で繰り返して得られた 吸収スペクトルであり、実験結果(プロット)とスペクト ル理論解析結果(破線)を比較して示している.異なる回 転準位の密度比を決める回転温度とスペクトル線の広がり を決める並進温度に等しい値を用いた理論計算により実験 結果がよく再現された.この結果に基づいて $N_2(A^3\Sigma_u^+)$ の絶対密度を求め、原子状窒素の密度と比較した[11].さ らに、 $N_2(A^3\Sigma_u^+)$ 密度と原子状窒素密度の放電条件に対す る変化をシリコンの窒化パフォーマンスと比較することに より、シリコンの窒化において $N_2(A^3\Sigma_u^+)$ が原子状窒素よ り高い効率を持つことを示唆した[12].

3.2 シリコン薄膜成膜プラズマにおける CRDS 計測

水素化アモルファスシリコン膜のシランプラズマ CVD における薄膜堆積のプリカーサは SiH₃ ラジカルであるこ とが知られている.プラズマ中の SiH₃ 密度を最初に測定し たのは赤外半導体レーザー吸収分光法を用いた板橋らの研 究だが[13],産業技術総合研究所太陽光発電工学研究セン ターでは、VHF シランプラズマ中の SiH₃ ラジカルの密度 を CRDS を用いて計測する実験が行われた[14].

光源はパルス色素レーザーで、吸収線には $\tilde{A}^2 A_1' - \tilde{X}^2 A_1$ (波長 220 nm 帯)が用いられた. 共振器は反 射率99%のミラーからなり、共振器長は 125 cm である. レーザー光の強度を変化させた実験で同じリングダウン曲 線が得られることから、吸収の飽和が無視できる条件で実 験が行われていることを確認している. 紫外域での実験で 共振器ミラーの反射率があまり高くないため、感度の高い 測定は実現されていないものの、 10^{12} cm⁻³ オーダーの SiH₃ 密度の計測に成功している. また、彼らは、プラズマ







図8 VHF シランプラズマで観測された共振器内における光子損 失の時間変化.

放電を開始した後のリングダウン周波数の変化に着目して 実験を行っている.典型的な結果を図8に示した.放電を 開始した後0.7 s 程度の時間帯において,SiH₃による *al* = 10⁻⁴ オーダーの吸収が観測されているが,その後の時 間帯で観測されている大きな光子損失は,プラズマ中で発 生したダスト粒子によるものである.シランプラズマ中で はダスト粒子が発生しやすく,それが薄膜中に混入すると 太陽電池膜の光劣化を引き起こすことが知られている.ダ スト粒子は,通常,レーザーミー散乱法によって検出され ているが,この実験では,SiH₃密度計測の副産物とし て,ミー散乱法では検出不可能なレベルのダスト粒子の検 出に成功しており,その後の研究においてプラズマ中での ダスト粒子の発生機構が調べられている[15].

その他に、シリコン薄膜成膜プラズマにおける CRDS を用いた最近の研究として、比較的圧力の高い高周波プラ ズマ (メゾプラズマ)中におけるn = 2状態水素原子密度を 測定した実験がある[16]. 色素レーザーを光源に用い、水 素原子のバルマーa線の吸収を CRDS で測定したものであ り、シリコン膜の高速エピタキシャル成長における H (n = 2)の寄与を議論している. H (n = 2)密度の測定はラ イマンa線の強度を発光分光計測することでも可能だ が、プラズマ中での光子補足の評価は簡単ではない. H (n = 2)密度の実測には吸収分光法を用いた方がよいが、 通常の吸収分光法では感度が不足する場合がほとんどであ り、CRDS の効用が活用できる例と考えられる.

3.3 水素負イオン密度計測

プラズマ中の水素負イオン密度計測には、長年、ラング ミュアプローブ支援レーザー光脱離法[17]が用いられて きたが、非接触計測でないという欠点がある.光脱離は負 イオンの光電離であり、レーザー光子が失われるので、プ ラズマを透過したレーザー光の強度の低下から負イオンの 密度を求めることが原理的には可能だが、光脱離断面積が 小さいことから通常の吸収分光法の配位でそれを実測する ことは容易でない.

中野らは、核融合科学研究所のアーク放電水素負イオン 源の引き出し電極近傍における水素負イオン(H⁻)密度を CRDS で測定している[18].彼らの実験装置の概要を図9 に示した.光源はパルス発振 Nd:YAG レーザーの基本波 (波長 1.06 µm)である.観測ポートは共振器ミラーによっ て真空封じされており、Oリングの弾力を利用してミラー の角度を外部から手動で微調整できるようになっている. レーザー光の伝送光学系および共振器は図9の縦方向およ び紙面を貫く方向に可動であり、H⁻密度の2次元空間分 布を高い実験効率で取得できる計測システムが構築されている.

光電離は共鳴的な過程でなく、レーザー光子のエネル ギーが負イオンの電離電圧(電子親和力)を超えていれば 波長を選ばない.また、吸収の飽和が生じる心配が無く、 懸念事項の少ない計測が可能である.中野らと同様の CRDSによるH⁻密度計測は、東北大学など内外のいくつか の研究グループでも行われている[19].歴史的には、 He-Ne レーザーを光源とし、マルチパスセルを用いてレー



図9 核融合科学研究所アーク放電型負イオン源において H⁻密 度を CRDS によって測定するための実験装置.

ザー光をプラズマ中で96回通過させることによって10⁻⁴レ ベルのH⁻による吸収を観測した実験[20]が最初で,それ がCRDSによるH⁻密度計測に発展した.He-Neレーザーは 安価でどこの研究室にもあると思うが,これを用いて得が たいプラズマパラメータを計測することが可能であること を示す教訓的な研究であった.

3.4 プラズマ支援微少火炎における OH 密度計測

プラズマ支援燃焼[21]において OH ラジカルが重要な役 割を果たしているとの推測から,筆者らは,誘電体バリア 放電が重畳された予混合バーナー火炎中の OH 密度を近赤 外 (~1.5 µm)の CRDS によって測定することを計画した. この実験により,測定対象が曲率半径の小さな屈折率分布 を有する場合に付加的な光子損失が生じ,その低減には共 振器ミラー径の選択が重要であるとの知見が得られた.

ミラー間隔が 25 cm の共振器の中に直径が約 2 mm の予 混合バーナー火炎を置き,連続発振半導体レーザー光を AOM を介して共振器内に注入した.空の共振器のリング ダウン周波数は $1.57 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$ であったが,火炎を発生さ せ,レーザー波長を OH の $X(2-0)P_{1e}(8.5)$ の吸収線に同 調すると,リングダウン周波数は $6.92 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$ に増加し た.一方,火炎を発生させレーザー光の周波数を吸収線波 長からずらした時には, $5.19 \times 10^5 \text{ s}^{-1}$ のリングダウン周波 数が観測された.即ち,OH による光吸収は観測されてい るものの,同時に,OH による光吸収以外の理由によるリ ングダウン周波数の増加が付加的に生じていることを示す 結果が得られた.

上のデータを得たときに使用した共振器ミラーの直径は 6 mm であったが, 直径 30 mm のミラーに変更し, ミラー の前にサイズの異なる絞りを置くことでミラー径を実効的 に変化させてリングダウン周波数を調べた. 空の共振器に おけるリングダウン周波数はミラー径に依存しなかった が, 火炎を発生させ, レーザー波長を吸収線からずらした 時に観測されたリングダウン周波数はミラー径に依存し た. 付加的に生じたリングダウン周波数を図10に示す. 付 加的なリングダウン周波数はミラー径が小さくなるにつれ て急激に増加しており,共振器ミラーの端からの光子の漏 れが付加的なリングダウン周波数の原因であることが強く 示唆される.火炎は高温で屈折率が1よりわずかに小さ く,そこでの屈折などが付加的な光子損失をもたらしてい るものと考えられる.一方,図10からは,ミラー径に依存 しない付加的光子損失の存在も読み取れるが,そのメカニ ズムは未解明である.いずれにしても,測定対象が周囲と 異なる屈折率を持ち,その曲率半径が小さいときには,屈 折などに起因する付加的な光子損失に留意して共振器を設 計する必要があると考えられる.今後,マイクロプラズマ などに CRDS を適用する際には注意が必要である.

4. キャビティリングダウン吸収分光法の動向 4.1 キャビティリングダウン吸収分光法の発展形

これまでにCRDSの様々な変形・発展形が開発されてお り、代表的な方法に以下がある。キャビティ増強吸収分光 法(Cavity Enhanced Absorption Spectroscopy(CEAS)) はCRDSと同じ装置を用いるが、リングダウン時間を測定 するのではなく共振器を透過したレーザー光の強度をその まま測定する方法で、光スイッチを用いてレーザー光強度 を遮断しないので簡便な計測法となる[22].位相シフト CRDSは、連続発振レーザー光の強度をAM変調し、共振 器に入射するレーザー光の変調位相に対する共振器を透過 したレーザー光の変調位相のずれを測定することにより、 CRDSにおけるリングダウン時間τを算出する方法である [23].光スイッチを用いたレーザー光の高速遮断を行わず にτを読み取る点に特徴がある。

これまで述べた方法は、吸収線の線幅と同等かそれより 狭い線幅のレーザーを光源に用いることを前提としてい た.一方、吸収線の線幅よりも線幅の広い光源を用いた広 帯域 CRDS も開発されている[24].共振器を透過した光 を分光した上で各波長成分のリングダウン時間を求める 様々な方法が考えられている.狭帯域レーザーを光源に用



図10 CRDS による予混合微小バーナー火炎中の OH ラジカル密 度計測において OH ラジカルによる吸収以外の理由で付加 的に生じたリングダウン周波数の共振器ミラー径に対する 依存性.

いた場合には、吸収スペクトルを得るためにはレーザー光 の波長を掃引して測定を繰り返す必要があるが、広帯域 CRDS を用いれば波長掃引が必要なくなる利点がある.光 源にフェムト秒レーザーを用いた Sadeghi らの方法は広帯 域 CEAS の一例である[25].

4.2 キャビティリングダウン吸収分光法を用いたプラズ マ診断の今後

最近,反応性プラズマの分野では,プラズマと液体との 相互作用に関する研究が高い関心を集めている.プラズ マ・液体界面のプラズマ側(気相側)における計測は,多 くの場合大気圧プラズマ中での計測のため従来の減圧プラ ズマ中での計測に比べて注意する点が多く困難性が高いも のの[26,27],従来の方法の延長線上にある方法により可 能であるといえる.これに対し,プラズマ・液相界面の液 体側における反応活性種などの検出・密度計測は,反応性 プラズマコミュニティにとって難関である.

一方,分析化学などの分野では,液体中でのCRDS計測 に関する研究が2000年頃から発表されはじめ.既に広く使 われる方法になっている[28,29].液体中ではレーリー散 乱が強いので吸収長を長くとるとリングダウン時間が短く なりCRDSのうまみが損なわれる.そのため,共振器内で 往復するレーザー光の伝搬距離として1kmを下回るシス テムがほとんどだが,それでも従来のUV-Vis吸光分光や 液体クロマトグラフィ計測に比べて著しく高い感度が得ら れている.共振器ミラーを液体中に置くことは実質的にで きないので,プリズムの背面からレーザー光を入射してエ バネッセント波モードを利用して吸収体とカップルさせる 方法や,光ファイバーを用いて共振器を構成する方法など が様々に開発されている.これらの方法はプラズマで誘起 された液体中の活性種の検出・密度計測に利用できる可能 性があり,今後の検討が期待される.

5. おわりに

キャビティリングダウン吸収分光法によるプラズマ計測 について,基礎的事項および計測事例を紹介した.CRDS を用いると,単純な吸収分光法の10⁴倍以上の感度を比較 的簡単に得ることができる.レーザー応用分光計測につい てあまり経験をおもちでない方は,この方法を難しい方法 と感じられるかもしれない.しかし,筆者の経験からは, 真剣に取り組めば何とか結果を出すことができる程度の困 難さをもつ方法であると思う.通常の吸収分光で感度が足 りない実験をおもちの方には積極的な導入をお勧めする.

参考文献

- [1] D.Z. Anderson et al., Appl. Opt. 23, 1238 (1984).
- [2] A. O'Keefe and D.A.G. Deacon, Rev. Sci. Instrum. **59**, 2544 (1988).
- [3] G. Meijer et al., Proc. 6th Int. Symp. Laser-Aided Plasma Diagnostics (Bar Harbor, USA, 1993) p.273.
- [4] K.W.Busch and M.A.Busch ed., Cavity-Ringdown Spectroscopy: an Ultratrace-Absorption MeasurementTechnique (Americal Chemical Society, 1999).
- [5] G. Berden and R. Engeln ed., Cabity Ring-Down Spectros-

Commentary

copy: Techniques and Applications (Wiley, 2009).

- [6] W. Demtroeder, *Laser Spectroscopy: Vol. 1: Basic Principles* (Springer, 2008).
- [7] J.U. White, J. Opt. Soc. Am. 32, 285 (1942).
- [8] 佐々木浩一: プラズマ・核融合学会誌 83,573 (2007).
- [9] C.O. Laux and C.H. Kruger, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 48, 9 (1992).
- [10] Y. Horikawa et al., J. Phys. Conf. Series 227, 012012 (2010).
- [11] Y. Horikawa et al., Jpn. J. Appl. Phys. 49, 026101 (2010).
- [12] Y. Horikawa et al., Appl. Phys. Express 4, 086201 (2011).
- [13] N. Itabashi et al., Jpn. J. Appl. Phys. 29, L505 (1990).
- [14] T. Nagai et al., Jpn. J. Appl. Phys. 45, 8095 (2006).
- [15] T. Nagai et al., Jpn. J. Appl. Phys. 47, 7032 (2008).
- [16] S. Wu et al., Jpn. J. Appl. Phys. 52, 071301 (2013).



佐々木浩

北海道大学大学院工学研究院量子理工学部 門・教授.研究分野はプラズマ応用工学. プラズマ応用の研究では学際分野の開拓が 必須なので,従来からの研究に加え、レー

ザープロセシング, 燃焼科学, 超臨界流体, 超音波エレクト ロニクスなどの分野との連携を進めています. 最近の私的な 関心事はあいかわらず視力です. ますます老眼が進行し, さ らにレーザーの調整に支障を感じるようになり, かなり困っ ています. 同様の悩みを克服された方からのアドバイスに期 待いたします.

- [17] M. Bacal et al., Rev. Sci. Instrum. 50, 719 (1979).
- [18] H. Nakano et al., AIP Conf. Proc. 1515, 237 (2013).
- [19] N. Tanaka et al., Rev. Sci. Instrum. 83, 02A731 (2012).
- [20] E. Quandta et al., Appl. Phys. Lett. 72, 2394 (1998).
- [21] S.M. Starikovskaia, J. Phys. D: Appl. Phys. 39, R265 (2006).
- [22] R. Engeln et al., Rev. Sci. Instrum. 69, 3763 (1998).
- [23] J. H. van Helden et al., Chem. Phys. Lett. 400, 320 (2004).
- [24] S. M. Ball and R. L. Jones, Chem. Rev. 103, 5239 (2003).
- [25] T. Gherman et al., J. Phys. D: Appl. Phys. 37, 2408 (2004).
- [26] H. Ishigame et al., Jpn. J. Appl. Phys. 54, 01AF02 (2015).
- [27] K. Urabe et al., J. Phys. D: Appl. Phys. 47, 262001 (2014).
- [28] L. van der Sneppen *et al.*, Annu. Rev. Anal. Chem. **2**, 13 (2009).
- [29] H. Waechter et al., Sensors 2010, 1761 (2010).